



Der **CiS LABday** behandelt das Thema

Piezoresistive Si-Drucksensoren

Der **CiS LABday** wird als eigenständige Veranstaltung vom CiS Forschungsinstitut angeboten. Er bietet auch eine ideale Ergänzung zum AMA Seminar Druckmesstechnik (08.11.2023).

Der **CiS LABday** fasst die Inhalte des AMA Seminars zusammen und ergänzt um praktische Inhalte, die in Form von Demonstratoren, Live-Vorführungen sowie anschaulichen Präsentationen, Wissenswertes zu piezoresistiven Silizium-Drucksensoren vermitteln.

Folgende THEMEN werden in Kleinstgruppen vertieft:

- Aufbau- und Verbindungstechnik für Drucksensoren
- Unterschied Stromspeisung, Spannungspeisung
- Kennlinienbestimmung und Ableitung von Parametern
- Analytische Methoden zur Charakterisierung
(REM, Laserscanning Microscope)

ORGANISATORISCHES

DATUM: Donnerstag, 9. November 2023

ZEIT: 10:00 bis 16:00 Uhr

ORT: CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik
Konrad-Zuse-Str. 14 in 99099 Erfurt

TEILNEHMER: mindestens 10

GEBÜHR: 350,00 € (inkl. Catering, zzgl. 19% Mehrwertsteuer)

WISSENSCHAFTLICHE LEITUNG:

Prof. Thomas Ortlepp, Dr. Klaus Ettrich

Es wird eine Teilnehmer-Bescheinigung ausgestellt.

Eine Anmeldung ist ab sofort über diesen Link möglich:

www.cismst.de/LABday/

CiS LABday 9.11.23
Piezoresistive Si-Drucksensoren